

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN na budowie Kampusu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Plac budowy Kampusu odwiedziła delegacja z Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Był to główny punkt wizyty gości w regionie świętokrzyskim.

W dniu 21 marca 2023 r. plac budowy Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM odwiedzili przedstawiciele Prezydium oraz członkowie Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele Komitetu zwiedzili pomieszczenia Kampusu oraz zapoznali się z zastosowanymi w budynkach rozwiązaniami technicznymi.

Goście zwiedzali plac budowy w towarzystwie Prezesa GUM, prof. Jacka Semaniaka oraz Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, Andrzeja Kurkiewicza.

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN zajmuje się w szczególności opracowywaniem i analizą metod pomiarowych, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i interpretacją informacji ilościowej o zjawiskach elektrycznych i nieelektrycznych, oceną błędów i niepewności pomiaru.

